



Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

119361, Москва, ул. Озерная, 46; Телефон: 8 (495) 437 56 33; факс: (495) 437 31 47

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 18/18.12.14-01.00276-2014

«Методика измерений линейных размеров с помощью микроскопа электронного растрового»

устанавливает совокупность операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений произвольных структур на поверхности твердых образцов методом растровой электронной микроскопии.
(2014 г., 12 стр.).

Методика разработана федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Центр коллективного пользования Научно-технологический центр «Нано - и микросистемной техники» ЦКП НТЦ НМСТ) Адрес: Россия, 124460. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5, аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики измерений.

В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявленным к ней метрологическим требованиям и обладает следующими метрологическими характеристиками:

Диапазон измеряемых величин составляет от 0.1 мкм до 5000 мкм, при увеличении от 1500 до 100000 крат.

Приписанная допускаемая относительная погрешность измерений составляет не более 5 % (при доверительной вероятности $P = 0,95$)

Директор  В.Н. Крутиков

18 декабря 2014 г.

ОА № XIV 002028